Searching PAJ

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-044601

(43)Date of publication of application: 16.02.2001

(51)Int.Cl.

HO5K

B05C 5/02

2/01 B41J

(21)Application number: 11-216809

(71)Applicant:

BROTHER IND LTD

(22)Date of filing:

30.07.1999

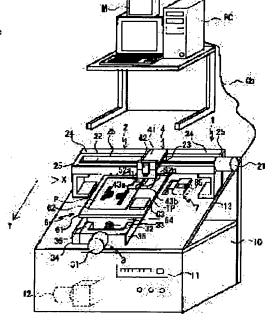
(72)Inventor:

SAKAIDA KAZUICHI

IMAEDA MIKIO

# (54) EQUIPMENT FOR FORMING WIRING PATTERN ON PRINTED BOARD

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain equipment for forming wiring pattern on a printed board wherein failure of an inkjet head can be easily detected before image drawing, inspection by an examiner after image drawing can be omitted, and proper measure with the detected failure is enabled. SOLUTION: In equipment 1 for forming wiring pattern on a printed board, a carriage 41 provided with a first inkjet head 43a, a second inkjet head 43b and a CCD camera 42 is moved in a main scanning direction with an X axis driving part 2. A stage 6 provided with an image drawing area 62 mounting a printed board P and an inspecting area 63 mounting a test piece TP is moved in an auxiliary scanning direction with a Y axis driving part 3. A test pattern is formed on the test piece TP, and the spouting of ink HI is inspected by image recognition with the CCD camera 42. Spouting position of ink is corrected if necessary, or after the inkjet head 43 is exchanged, a wiring pattern of the printed board P is formed.



## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-44601

(P2001-44601A)

(43)公開日 平成13年2月16日(2001.2.16)

(51) Int.Cl.7		識別記号	•	FΙ	•	テーマコート*(参考)
H05K	3/06			H05K	3/06	F 2C056
B05C	5/02			B 0 5 C	5/02	4F041
B41J	2/01			B41J	3/04	101Z 5E339

#### 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 22 頁)

(21)出願番号	特願平11-216809	(71)出願人	000005267		
			プラザー工業株式会社		
(22)出願日	平成11年7月30日(1999.7.30)	愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号			
		(72)発明者	坂井田 和一		
			名古屋市瑞穂区苗代町15番1号 プラザー		
	,		工業株式会社内		
•		(72)発明者	今枝 幹雄		
	·		名古屋市瑞穂区苗代町15番1号 プラザー		
			工業株式会社内		
		(74)代理人			
		. 316270	弁理士 中嶋 恭久 (外1名)		

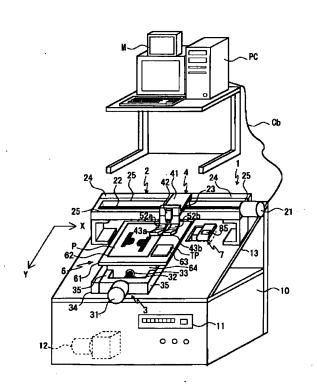
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 プリント基板の配線パターン形成装置

# (57)【要約】

【課題】 インクジェットヘッドの不良を描画前に簡単に発見でき、検査員による描画後の検査が省略できるとともに、発見した不良に対して適切な対応をとることが可能なプリント基板の配線パターン形成装置を提供すること。

【解決手段】 プリント基板の配線パターン形成装置1は、第1インクジェットへッド43a、第2インクジェットへッド43b、CCDカメラ42を備えたキャリッジ41がX軸駆動部2によって主走査方向に移動し、プリント基板Pを載置する描画エリア62とテストピースTPを載置する検査エリア63を備えたステージ6はY軸駆動部3によって副走査方向に移動し、テストピースTP上にテストパターンを形成してCCDカメラ42により画像認識してインクHIの吐出の検査を行う。必要に応じてインクの吐出位置の補正を行い、又はインクジェットへッド43を交換してから、プリント基板Pの配線パターンの形成を行う。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 プリント基板を載置する描画エリアと、前記描画エリア外に設けられ、テストピースを載置する検査エリアと、

前記描画エリアに載置されたプリント基板及び前記検査 エリアに載置されたテストピースに対して相対移動可能 に設けられ、インクを吐出して前記プリント基板上に配 線パターンを形成し、且つ前記テストピース上にテスト パターンを形成することが可能なインクジェットヘッド と

前記検査エリアにおいて前記インクジェットヘッドにより前記テストピース上に形成されたテストパターンを認識する認識手段と、

前記認識手段により認識されたテストパターンのインク の吐出位置を判断する判断手段とを備えたことを特徴と するプリント基板の配線パターン形成装置。

【請求項2】 前記判断手段により、前記インクジェットへッドから吐出されたインクの着弾位置が所定位置からずれていると判断された場合に、前記プリント基板上において前記配線パターンを形成するときのインクの吐出位置を補正する補正手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載のプリント基板の配線パターン形成装置。

【請求項3】 前記インクジェットヘッドは、

複数のノズルが略直線状に配置されたアレイ状に形成され、前記ノズルが配列された方向と垂直な方向に前記プリント基板に対して相対移動して主走査し、該主走査方向と垂直な方向に前記プリント基板に対して相対移動して副走査するように構成され、

#### 前記補正手段は、

前記判断手段により判断された前記インクジェットへッドの各ノズルによる副走査方向のずれの大きさに基づいて複数のグループに分け、該グループ毎に異なる距離の副走査を行って主走査を行うことを特徴とする請求項2に記載のプリント基板の配線パターン形成装置。

### 【請求項4】 前記補正手段は、

前記判断手段により判断された前記インクジェットヘッドの各ノズルによる主走査方向のずれの大きさに基づいて、ノズル単位で所定のインクの吐出タイミングに対してタイミングをずらしてインクを吐出することを特徴とする請求項2又は請求項3に記載のプリント基板の配線パターン形成装置。

【請求項5】 前記判断手段により、インクジェットへッドの吐出不良と判断された場合に、

前記インクジェットヘッドのインクの吐出を修復させる 修復手段を備えたことを特徴とする請求項1乃至請求項 4のいずれかに記載のプリント基板の配線パターン形成 装置。

## 【請求項6】 前記修復手段は、

パージ機構及びワイプ機構のうち少なくとも1つを備えたことを特徴とする請求項5に記載のプリント基板の配

#### 線パターン形成装置。

【請求項7】 複数のインクジェットヘッドを備え、前記判断手段により、前記修復手段によっては1のインクジェットヘッドのインクの吐出を修復できなかったと判断された場合に、前記1のインクジェットヘッドと異なる他のインクジェットヘッドにより前記プリント基板上に前記配線パターンを形成することを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれかに記載のプリント基板のパターン形成装置。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェットへ ッドを用いてプリント基板に配線パターンを形成するプ リント基板の配線パターン形成装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、プリント基板の配線パターンを製作する場合は、フォト法やスクリーン法によりエッチングが行われていた。これらの方法は、銅板などにレジストを塗布するかドライフィルムを接着し、写真製版されたマスクで覆って露光を行い、現像して配線パターンに応じたレジストパターンを形成する。その上でエッチングを施すという多段階に亘る処理を行って配線パターンを製作するものであった。近年、このレジストパターンの形成をインクジェットプリンターで直接描画する装置が提案された。この装置によれば、インクジェットへッドを用いて配線パターンを描画するだけで、極めて容易にレジストパターンが形成できるようになった。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、インク ジェットヘッドを用いて描画する場合は、インクの吐出 が不良となり形成されたレジストパターンに不良を生じ させる場合がある。そのため、描画が完了すると検査員 が顕微鏡を使用して断線などの配線不良の有無を検査し ていた。またこの検査は描画の完了直後でなく、エッチ ング、レジスト除去の段階を経たパターンの完成状態に て行うことが少なくない。この検査は形成されたレジス トパターンを介してインク吐出ヘッドの吐出不良状態を 発見するもので、インクジェットヘッド自体の状態を直 接検査するものではなく、細かい配線をすべてチェック するのは極めて煩雑な作業であるので、完全な検査を行 うのに自ずと限界があるという問題があった。また、こ れを解決するために、特開昭63-200041号公報 において提案されているような、描画中に不良箇所をC CDカメラで記憶しておき、修正作業を行うものがあっ たが、これによってもパターン不良が出た後の処理とな ってしまい、適切な対応をとることができないという問 題があった。

【 0 0 0 4 】この発明は上記課題を解決するものであり、インクジェットヘッドの不良を描画前に簡単に発見でき、検査員による描画後の検査が省略できるととも

に、発見した不良に対して適切な対応をとることが可能なプリント基板の配線パターン形成装置を提供することを目的とする。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために、請求項1に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、プリント基板を載置する描画エリアと、前記描画エリア外に設けられ、テストピースを載置する検査エリアと、前記描画エリアに載置されたプリント基板及び前記検査エリアに載置されたテストピースに対して相対移動可能に設けられ、インクを吐出して前記プリント基板上に配線パターンを形成し、且つ前記テストピース上にテストパターンを形成することが可能なインクジェットへッドと、前記検査エリアにおいて前記インクジェットへッドにより前記テストピース上に形成されたテストパターンを認識する認識手段と、前記認識手段により認識されたテストパターンのインクの吐出位置を判断する判断手段とを備えたことを特徴とする。

【0006】この構成に係るプリント基板の配線パターン形成装置では、描画エリアで配線パターンが形成されたプリント基板とは別に、検査エリアでテストパターンが形成されたテストピースを認識し判断するため、インクジェットヘッドのインクの吐出の着弾位置のずれや、吐出不良などがわかり、描画エリアでプリント基板に配線パターンを形成する前にインクの吐出不良による配線パターンの形成の不良を簡単に回避でき、且つ検査員による描画後の検査が省略できる。従って、不良品を出さないで、プリント基板に配線パターンのレジストパターンを高い生産効率で高精度に形成することができる。

【0007】請求項2に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、請求項1に記載のプリント基板の配線パターン形成装置の構成に加え、前記判断手段により、前記インクジェットヘッドから吐出されたインクの着弾位置が所定位置からずれていると判断された場合に、前記プリント基板上において前記配線パターンを形成するときのインクの吐出位置を補正する補正手段を備えたことを特徴とする。

【0008】この構成に係るプリント基板の配線パターン形成装置では、判断手段によりインクジェットヘッドから吐出されたインクの着弾位置が所定位置からずれていると判断された場合には、補正手段によりインクの吐出位置を補正することができる。従って、より高精度に配線パターンをプリント基板上に形成できる。

【0009】請求項3に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、請求項2に記載のプリント基板の配線パターン形成装置の構成に加え、前記インクジェットヘッドは、複数のノズルが略直線状に配置されたアレイ状に形成され、前記ノズルが配列された方向と垂直な方向に前記プリント基板に対して相対移動して主走査し、該主走査方向と垂直な方向に前記プリント基板に対

して相対移動して副走査するように構成され、前記補正 手段は、前記判断手段により判断された前記インクジェットヘッドの各ノズルによる副走査方向のずれの大きさ に基づいて複数のグループに分け、該グループ毎に異な る距離の副走査を行って主走査を行うことを特徴とす る。

【0010】この構成に係るプリント基板の配線パターン形成装置では、複数のノズルが略直線状のアレイ状に配置されたインクジェットへッドにより、1回の主走査で複数のラインを形成できるばかりでなく、判断手段により求められた各ノズルの副走査方向のずれの大きさに基づいて複数のグループに分け、該グループ毎に異なる距離の副走査を行って主走査を行うことにより、複数のノズルから射出される各ノズル固有の着弾位置のずれを修正し、インクジェットへッド全体の位置のずれを簡単な制御で極めて小さいものとすることができる。従って、ノズル毎の副走査方向の着弾位置のずれの大きさにかかわらず、極めて高い精度でプリント基板の配線パターンを形成することができる。

【0011】請求項4に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、請求項2又は請求項3に記載のプリント基板の配線パターン形成装置の構成に加え、前記補正手段は、前記判断手段により判断された前記インクジェットヘッドの各ノズルによる主走査方向のずれの大きさに基づいて、ノズル単位で所定のインクの吐出タイミングに対してタイミングをずらしてインクを吐出することを特徴とする。

【0012】この構成に係るプリント基板の配線パターン形成装置では、判断手段により判断された各ノズルの主走査方向のずれの大きさに基づいて、ノズル単位で所定のインクの吐出タイミングに対してタイミングをずらしてインクを吐出することにより、複数のノズルから射出される各ノズル固有の着弾位置のずれを修正し、インクジェットヘッド全体の位置のずれを簡単な制御で極めて小さいものとすることができる。従って、ノズル毎の主走査方向の着弾位置のずれの大きさにかかわらず、極めて高い精度でプリント基板の配線パターンを形成することができる。

【0013】請求項5に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、請求項1乃至請求項4のいずれかに記載のプリント基板の配線パターン形成装置の構成に加え、前記判断手段により、インクジェットへッドの吐出不良と判断された場合に、前記インクジェットへッドのインクの吐出を修復させる修復手段を備えたことを特徴とする。

【0014】この構成に係るプリント基板の配線パターン形成装置では、描画エリアでプリント基板に配線パターンを形成する前に判断手段によりインクジェットヘッドのインクの吐出不良と判断された場合に、修復手段によりインクジェットヘッドのインクの吐出を修復させる

ことができる。従って、判断手段によりインクの吐出が 不良と判断されても、インクの吐出不良がない状態に修 復可能で生産ラインの作業を中断することなく描画エリ アでプリント基板に配線パターンを形成することができ る

【0015】請求項6に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、請求項5に記載のプリント基板の配線パターン形成装置の構成に加え、前記修復手段は、パージ機構及びワイプ機構のうち少なくとも1つを備えたことを特徴とする。

【0016】この構成に係るプリント基板の配線パターン形成装置では、パージ機構あるいはワイプ機構又はその双方によりインクジェットヘッドのインクの吐出を確実に修復することができる。

【0017】請求項7に係る発明のプリント基板のパターン形成装置では、請求項1乃至請求項6のいずれかに記載のプリント基板のパターン形成装置の構成に加え、複数のインクジェットへッドを備え、前記判断手段により、前記修復手段によっては1のインクジェットへッドのインクの吐出を修復できなかったと判断された場合に、前記1のインクジェットへッドと異なる他のインクジェットへッドにより前記プリント基板上に前記配線パターンを形成することを特徴とする。

【0018】この構成に係るプリント基板の配線パターン形成装置では、修復手段によっては1のインクジェットヘッドのインクの吐出を修復できなかったと判断された場合でも、複数のインクジェットヘッドを備えているため、プリント基板の配線パターン形成装置の稼働を中断することなく、1のインクジェットヘッドと異なる他のインクジェットヘッドによりプリント基板上に配線パターンを形成することができる。従って、生産ラインの作業を中断することなく、高い生産効率でプリント基板の生産をすることができる。

#### [0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係るプリント基板の配線パターン形成装置を好ましい1の実施の形態であるプリント基板の配線パターン形成装置(以下配線パターン形成装置という。)1により、添付図面を参照して説明する。まず最初に、配線パターン形成装置1の構成について図面を参照しながらその概略を説明する。

【0020】図1は、配線パターン形成装置1の概略を示す図である。図1で示すように、配線パターン形成装置1は、箱形に形成された本体10の上部に、前面側(図1においてY方向)が下がるように傾斜させた天板13が設けられ、天板13上には第1インクジェットへッド43a、第2インクジェットへッド43b(以下これらをまとめてインクジェットへッド43という。)などを支持するキャリッジ41を備えたヘッド部4が、X軸駆動部2によりX軸方向(図1において矢印X方向及び反X方向)に変位可能に支持されている。また、この

インクジェットヘッド43に対向して、プリント基板P を載置する領域である描画エリア62と、描画エリア6 2の領域外に設けられテストピースTPを載置する検査 エリア63とを備えたステージ6が、Y軸駆動部3によ りY軸方向(図1において矢印Y方向及び反Y方向)に 変位可能に支持されている。上記のように支持されたイ ンクジェットヘッド43とステージ6とが相対的に2次 元的に移動して、プリント基板P上でインクジェットへ ッド43が主走査及び副走査を行いインクを吐出して配 線パターンを形成する。さらに、キャリッジ41には、 検査エリア63のテストピースTP上に形成されたテス トパターンを認識する認識手段であるCCDカメラ42 が備えられる。また、ステージ6のX方向側後部には、 インクの吐出不良の場合の修復手段であるメンテナンス 部7を備える。そして、本体10下部には、配線パター ン形成装置1を制御する制御部(不図示)の制御板11 が設けられ、配線パターン形成装置1とは別体に設けら れた判断手段・制御手段であるコンピュータPCと、C CDカメラ42によるドット抜け検査や着弾位置計測画 像の確認をする画像をモニタするモニタMが備えられ、 配線パターン形成装置1とケーブルCbにより接続され ている。

【0021】以下各部の構成を詳細に説明する。本体10は、全体が箱状で、その上部に天板13がおよそ47。程度傾斜した状態で設けられている。本体10内には、制御部(不図示)の操作パネルである制御盤11が前面に設けられる。また、プリント基板Pを吸着固定するための負圧を生起させる基板吸引ポンプ12が本体10内に設けられ、描画エリア62及び検査エリア63にパイプが接続されており、プリント基板P及びテストピースTPが負圧により固定される。

【0022】X軸駆動部2には、キャリッジ41を主走 査方向であるX軸方向に案内しつつ摺動させる案内レー ルであるX軸ガイド25が設けられ、このX軸ガイド2 5に沿ってX軸リニアエンコーダ24が設けられてい る。X軸リニアエンコーダ24は、リニアスケールの4 逓倍で5μmと5分割の専用IC(図示外)によりX軸 方向のキャリッジ41位置を、1 µmの精度で読み取り 可能とする。キャリッジ41の下部には、X軸ボールね じ23が設けられ、ここに螺入されX軸駆動モータ21 に駆動されて回転する雄ねじであるX軸駆動軸22の回 転によりキャリッジ41がX軸方向あるいは反X軸方向 に移動する。X軸駆動モータ21は、1回転2000ス テップのACサーボモータからなり、また、X軸ボール ねじ23は、リードピッチが2mmとなっており、キャ リッジ41を、X軸リニアエンコーダ24と相俟って1 μmオーダーで走査可能に構成される。

【0023】一方、Y軸駆動部3は、ステージ6を副走 査方向であるY軸方向に案内しつつ摺動させる案内レー ルであるY軸ガイド35が設けられ、このY軸ガイド3 【0024】ステージ6は、Y軸ガイド35に案内されて摺動する基台64と、その上に設けられた矩形板状のステージプレート61を備える。ステージプレート61上にはプリント基板Pを載置する領域である描画エリア62が設けられ、前述の基板吸引ボンプ12によりプリント基板Pが吸着されて固定される。また、ステージプレート61上には、描画エリア62の領域外に設けられ、インクジェットへッド43のインクの吐出検査のテストパターンを形成するためのプリント基板Pと同一素材の小片からなるテストピースTPを載置する検査エリア63が設けられている。テストピースTPも前述の基板吸引ポンプ12により吸着されて固定される。

移動し描画のための主走査及び副走査を行う。

【0025】ヘッド部4は、第1インクジェットヘッド43a及び第2インクジェットヘッド43bからなる一対のインクジェットヘッド43を支持して移動するキャリッジ41を備える。第1インクジェットヘッド43aと第2インクジェットヘッド43bとは同様の構成である。インクジェットヘッド43は、常温では固体で加熱すると溶融するホットメルトインク(以下適宜インクと省略する。)HIを使用し、ピエゾ素子49(図3参照)の駆動により必要に応じてオンディマンドでインクを吐出するインクジェット装置である。

【0026】キャリッジ41には、前方(図1Y方向)にCCDカメラ42が備えられ、さらにその前方下部に、第1支持部52aを介して第1インクジェットへッド43a及び第2支持部52bを介して第2インクジェットへッド43bがそれぞれ支持される。なお、第1支持部52a及び第2女持部52bは、第1インクジェットへッド43a及び第2インクジェットへッド43bを、パージ動作時などにプリント面に対するへッド位置を変位させてメンテナンス部7のインク吸収ロール85に接離可能に構成されている。

【0027】図2は、ヘッド部4の機能の概略を示すブロック図である。ヘッド部4は、インクジェットヘッド43を備えたフロントエンドFEと、インクタンク主室71、インクタンク副室72を中心として構成されるバックエンドBEとから構成され、さらにこれらを制御する制御部54など、これらに付随するその他の部分と接続される。

【0028】ここで、図8は、第1インクジェットヘッ ド43aをノズル44面から見た模式図である。図8に 示すように第1インクジェットヘッド43aのノズル4 4面は、大きく4つのインクジェットヘッドユニット4 5k, 45c, 45m, 45y (以下これらをまとめて インクジェットヘッドユニット45という。)から構成 されている。なお、各インクジェットヘッドユニット4 5k, 45c, 45m, 45yは同一の構成であるが、 このように複数のインクジェットヘッドユニット45を 使用する場合は、それぞれの位置を順次副走査方向に、 副走査1回分の送り量δYだけずらしてオフセットし、 第1インクジェットヘッド43aを1回主走査させれ ば、4ライン分のプリントが可能になるため、配線パタ ーンの形成に要する時間を短縮できる。なお、このよう なオフセットを設けず、X軸方向に同一ライン上に並 べ、重ねてインクを吐出し、プリント基板P上のインク 厚を厚くする様な構成でもよい。また、第2インクジェ ットヘッド43bも同様に構成される。

【0029】図3は、図7におけるA-A部分における インクジェットヘッドユニット45の模式断面図であ る。図3に示すように、インクジェットヘッドユニット 45は、最上部に酸化アルミニウム(A12O3)から なる矩形板状の第2ベース部51bが設けられ、その下 部に、同様の大きさの板状部材であり、且つその主走査 方向(X軸方向)を長手方向とするように細長に形成さ れたピエゾ素子49を積層して収納可能な下側に開放し た凹部を有する第1ベース部51 aが積層される。第1 ベース部51aの凹部には、PZT(ジルコン酸鉛Pb ZrO<sub>3</sub>とチタン酸鉛PbTiO<sub>3</sub>の固溶体)から細長 に形成され複数の素子が積層されてアクチュエータとし て構成されたピエゾ素子49が収納され、第1ベース部 51aの下部には、これを覆うように薄板上のアラミド 樹脂からなるダイアフラム48が配設される。なお、ピ エゾ素子49には、図示しない電圧印加手段が配され、 駆動回路53 (図2参照) から電圧が印加されると歪ん でダイアフラム48を下方に押し出す。このダイアフラ ム48の下部には、キャビティ47が配設される。

【0030】キャビティ47には、導入路47aが、キャビティ47のX軸方向両端部近傍に平行且つ水平に1対配設される(図7参照)。導入路47aにはインクタンク主室71(図5参照)に連結され、インク供給パイプ76から供給されたインクHIを導入し貯留する。また導入路47aには、インクHIの温度の安定及びパー

ジ動作時にインクタンク副室72(図5参照)にインクHIを還流させるためにインク還流パイプ77(図5参照)が連通されている。この1対の導入路47aからそれぞれ対向するように多数の加圧路47bが平行に延設され(図7参照)、ダイアフラム48を介してピエゾ素子49に接するようにポンピングチャンバーとして配置される。さらに各ノズル44に連通する導出路47cが形成されている。

【0031】ノズルプレート46は、ジルコニア (酸化ジルコニウム・ $2rO_2$ )により、セラミックインジェクションモールドにより形成され、孔径が約 $40\mu$ mのノズル44が前述のように配置されて開口される。なお、ノズルプレート46を成型するとき、型への材料の流入が主走査方向に当たる方向から行われるので、各ノズル44の位置の誤差は、主走査方向に大きくなる傾向がある。

【0032】図7は、インクジェットヘッドユニット45の一部を拡大して見た底面図である。図7に示すように、加圧路47bは、両端に配設された導入路47aから、交互に多数対向するように設けられ、その先端部は下方に屈曲され導出路47cを形成し、ノズル44にインクHIを導出する。本実施の形態では、ノズル44の配置は、各インクジェットヘッドユニット45に副走査方向におよそ340μmの間隔で64個、これを幅およそ2mmで2列配置して計128個のノズルを有する。従って第1インクジェットヘッド43a及び第2インクジェットヘッド43bはそれぞれ512個のノズル44を有する。

【0033】次に、再び図2を参照して説明を続ける。 コンピュータPCは、入力されたプリントすべき配線パ ターンをRAM (不図示)の入力バッファにビットマッ プデータで記憶し、このビットマップデータから、イン クジェットヘッド43への転送順に合わせたプリント用 のビットマップデータに事前に変換しておきRAM内の 出力バッファに記憶しておく。X軸リニアエンコーダ2 4及びY軸リニアエンコーダ34(図1参照)から得た 位置情報に従って、主走査及び副走査に同調させてプリ ント用ビットマップデータを駆動回路53に送り吐出制 御を行う。駆動回路53は、所定のピエゾ素子49にパ ルス電圧を印加してアクチュエータであるピエゾ素子4 9を作動させて、ダイアフラム48を押し出し、キャビ ティ47の加圧路47bがポンピングチャンバーとして 機能して、インクHIを加圧して導出路47cを経てノ ズル44からインクHIを射出させる(図3参照)。

【0034】バックエンドBEは、インク供給・インク 循環、パージ、温度制御、インク貯留、インク液面検出 の機能を有するオンヘッドインクタンク部である。ここ で図5は、フロントエンドFE及びバックエンドBEの 構造を示す模式図である。

【0035】まず、図5に示すように、プリント時は、

インクタンク主室71及びインクタンク副室72との間 にある隔壁開閉弁75が開放されており、インクタンク 主室71及びインクタンク副室72に同じ液面レベルで 溶融したインクHIが貯留されている。インクタンク主 室71及びインクタンク副室72の下部には、タンクヒ ータ82が設けられる。またサーミスタにより構成され ているインクセンサ78によりインクHIの温度が検出 され、コンピュータPC (図1参照) によりタンクヒー タ82が制御されてその温度が略一定に保たれる。イン クタンク主室71の下部にはインクフィルター73が設 けられ、ヘッド詰まりの原因となる固形物を回収する。 インクタンク主室71に貯留されたインクHIはインク 供給パイプ76を通ってフロントエンドFEに供給さ れ、ノズル44から必要なインクHIが射出されインク HIが消費される。残りのインクHIは、インク還流パ イプ77からバックエンドBEに還流する。フロントエ ンドFEにおいても、フロントヒータ83が設けられ て、図示しない温度センサにより温度が検出されてイン クHIを適温に維持する。このようにインク還流パイプ 77からバックエンドBEに還流したインクHIは、イ ンクタンク副室72の逆止弁74からインクタンク副室 72に還流する。なお、逆止弁74は、インク還流パイ プ77からインクタンク副室72向きには流入するがそ の反対向きには流入しない構造の弁である。

【0036】ここで、インクHIを消費して、インク量 が5m1より減少して液面レベルが下がると、サーミス タであるインクセンサ78が、加熱溶融されたインクH Iの液面より露出し、サーミスタの検出温度が低下す る。この温度変化によりインクタンク主室71内の液面 を検出し、コンピュータPCにより、インクHIの補充 のメッセージをコンピュータPCの画面や、制御盤11 (図7参照)により使用者に報知する。この報知によ り、使用者はインクHIの補充の必要性を知ることにな る。インクの補充は、以下のように行う。インク溶融タ ンク80は、常温固体であるホットメルトインクHIの 補充用のナゲットを投入する場所で、ここにインクHI の補充用のナゲットを投入する。そうすれば、固形のイ ンクHIは、溶融ヒータ81により加熱されてインクH Iが溶融し3mlの液体インクとなり、インクタンク副 室72に流入されインクHIがHIレベルまで補充され る。従って、インクHIの液面は、常に図5の5mlの LOWレベルと8mlのHIレベルとの間に維持され

【0037】ここで、配線パターン形成装置1で使用するホットメルトインクHIについて説明する。上記した本発明において用いるビヒクル、またその他のビヒクルや添加剤などを用いる場合には、それらはすべて常温において固体であるので、本実施の形態のホットメルト型固体インクからなるホットメルトインクHIを調製するにあたり、それらをすべて溶融温度よりも高い温度にお

いて溶融し、良く混合して均一に分散させることが必要であり、かかる目的を達成することができるならば、本実施の形態のホットメルト型固体インクからなるホットメルトインクHIを調製する手段は、何ら限定されず、任意の手段を用いてよい。

【0038】先ず、溶融時に所定の特性を持つように組成を調製された各インク色のホットメルトインクHIが 所定の型を用いて固化されてインクペレットが形成される。

【0039】ホットメルトインクHIは、ポリアミド樹脂、テルペン系樹脂、ワックスなどの熱溶融性固体を主体として、色材及び界面活性剤や各種添加剤を含む。

【0040】本実施の形態において用いるホットメルト ポリアミド樹脂は、アミンと酸とを縮重合して得られる ものであり、アミンとしては、例えば、ヘキサメチレン ジアミンなどを用いることができ、酸としては、例え ば、アジピン酸、セバシン酸、無水トリメリット酸、ダ イマー酸などを用いることができ、更に、アミンと酸と を両方有するものとして、11-アミノウンデカン酸、 12-アミノドデカン酸などがあり、これらを組み合わ せることにより、所望の特性(アミン価、酸価)のポリ アミド樹脂を調製することができる。本実施の形態にお いて用いることができる市販のポリアミド樹脂の具体例 としては、例えば下記を挙げることができる。トーマイ ド90、トーマイド92、トーマイド391、トーマイ ド394、トーマイド394N、トーマイド395、ト ーマイド397、トーマイド509、トーマイド53 5、トーマイド558、トーマイド560、トーマイド 575、トーマイド1310、トーマイド1350(以 上、富士化成社製)、ポリマイドS-40HA、ポリマ イドS-40E、ポリマイドS-150、ポリマイドS -52、ポリマイドS-185、ポリマイドS-151 0、ポリマイドS-1525、ポリマイドS-163 5、ポリマイドS-1962、ポリマイドS-200 7、ポリマイドS-2153(以上、三洋化成社製)、 バーサミド335、バーサミド725、バーサミド74 4、バーサミド756、バーサミド930、バーサミド 940(以上、ヘンケル白水社製)、などがある。本実 施の形態においては、これらを単独で用いてもあるいは 二種又はそれ以上の混合物で用いてもよい。

【0041】本実施の形態において、ポリアミド樹脂は、インクHIの全重量を基準にして、ポリアミド樹脂の合計が5~50重量%の範囲になるような量で用いる。インクHI中のポリアミド樹脂の含有量が5重量%よりも少ないと、インクジェット記録方式で吐出させるのに十分な溶融粘度が得られないばかりでなく、またインクHIの透明性や印刷媒体への接着性も得られない。他方、インクHI中のポリアミド樹脂の含有量が50重量%よりも多くなると、インクHIの溶融粘度が高くなり過ぎるために、インクジェット記録に用いられるプリ

ンターヘッドの作動温度での良好なインクHIの吐出が 困難になるとともに、紙などに付着させた際のインクH Iの紙への染み込みが悪くなり、印字表面を手などで擦 るとインクHIが紙などから剥がれるなどして、良好な 印字品質を保持することができない。従って、ポリアミ ド樹脂は、その合計がインクHI中に10~30重量% の範囲で含有されるのが好ましい。

【0042】本実施の形態において、ワックスとして は、融点50~200℃を有し、熱に対して安定なもの を用いる。具体的には、石油ワックス、望ましくはパラ フィンワックスまたはマイクロクリスタリンワックス や、植物系ワックス、望ましくはキャンデリラワック ス、カルナウバワックス、ライスワックス、またはホホ バ固体ロウや、動物系ワックス、望ましくはミツロウ、 ラノリンまたは鯨ロウや、鉱物系ワックス、望ましくは モンタンワックスや、合成炭化水素、望ましくはフィッ シャートロプシュワックスまたはポリエチレンワックス や、水素化ワックス、望ましくは硬化ヒマシ油または硬 化ヒマシ油誘導体や、変性ワックス、望ましくはモンタ ンワックス誘導体、パラフィンワックス誘導体、マイク ロクリスタリンワックス誘導体またはポリエチレンワッ クス誘導体や、高級脂肪酸など油脂系合成ワックス、望 ましくはベヘン酸、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリ スチン酸、またはラウリン酸や、ケトンワックス、望ま しくはジステアリルケトンや、高級アルコール、望まし くはステアリルアルコール、またはベヘニルアルコール や、ヒドロキシステアリン酸、望ましくは12-ヒドロ キシステアリン酸または12-ヒドロキシステアリン酸 誘導体、脂肪酸アミドとしてラウリン酸アミド、ステア リン酸アミド、オレイン酸アミド、エルカ酸アミド、リ シノール酸アミド、ステアリン酸エステルアミド、パル ミチン酸アミド、ベヘン酸アミド、ブラシジン酸アミ ド、N-オレイルステアリン酸アミド、N-ステアリル ステアリン酸アミド、N-オレイルパルミチン酸アミ ド、N-ステアリルエルカ酸アミドなどが挙げられる。 また、ケトン、望ましくはステアロンまたはラウロン や、アミン、望ましくはドデシルアミン、ケトラデシル アミンまたはオクタデシルアミンや、エステル、望まし くはステアリン酸メチル、ステアリン酸オクタデシル、 グリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステ ル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、エチレング リコール脂肪酸エステル、またはポリオキシエチレン脂 肪酸エステルや、重合ワックス、望ましくはαーオレフ ィン無水マレイン酸共重合体ワックスなどの従来公知の ワックスのいずれかを特に限定することなく用いること ができる。これらのワックス類は単独でもしくは二種以 上を混合して用いることができる。

【0043】上記したワックスは、インクHIの全重量を基準にして、ワックスの合計が20~90重量%の範囲になるような量で用いる。インクHI中のワックスの

含有量が20重量%よりも少ないと、他の添加剤の特性が現れてくるためにインクHIの融点が高くなったり、インクジェットの吐出温度においてインクHIがシャープに溶けなくなる。また、含有量が90重量%よりも多いと、インクHIに透明性がなくなるとともに、溶融粘度が低くなりすぎて、インクジェット記録用のインクHIとして機能するのに十分な溶融粘度が得られなくなり、更に、OHP用シートへのインクHIの付着性が低くなる。

【0044】本実施の形態において用いるテルペン系樹 脂とは、ポリテルペンのことであり、代表的にはテルペ ンーフェノール共重合体、などがある。テルペン系樹脂 の具体例としては、YSレジンPX1250、YSレジ ンPX1150、YSレジンPX1000、YSレジン TO125、YSVジンTO115、YSVジンTO1 05、クリアロンP125、クリアロンP115、クリ アロンP105、クリアロンM115、クリアロンM1 05(ヤスハラケミカル社製)があり、テルペンーフェ ノール共重合体の具体例としては、YP-90L、YS ポリスター2130、YSポリスター2115、YSポ リスター2100、YSポリスターT145、YSポリ スターT130、YSポリスターT115、YSポリス ターT100(ヤスハラケミカル社製)、などを挙げる ことができる。本実施の形態においては、これらを単独 で用いてもあるいは二種又はそれ以上の混合物で用いて もよい。

【0045】本実施の形態において、テルペン系樹脂は、インクHIの全重量を基準にして、テルペン系樹脂の合計が1~10重量%の範囲になるような量で用いる。インクHI中のテルペン系樹脂の含有量が1重量%よりも少ないと、インクHIが加熱溶融状態で変色しやすくなるなど、本実施の形態の十分な効果が発揮されず、また10重量%よりも多いと、インクHIの透明性が悪くなり、溶融粘度が増大するなど、インクHI本来の性能を発揮できなくなる。プリンタによる印字時の印字品質を考慮すると、インクHI中のテルペン系樹脂の含有量は2~10重量%の範囲が好ましく、3~8重量%の範囲が更に好ましい。この変色防止などの本実施の形態の効果は、特にテルペンーフェノール共重合体を用いた場合に顕著であった。

【0046】本実施の形態で使用する色材としては、従来から油性インク組成物に用いられている染料及び顔料のいずれでも使用可能である。顔料は、有機または無機を問わず印刷の技術分野で一般に用いられているものを用いることができる。具体的には、例えばカーボンブラック、カドミウムレッド、モリブデンレッド、クロムイエロー、カドミウムイエロー、チタンイエロー、酸化クロム、ビリジアン、チタンコバルトグリーン、ウルトラマリンブルー、プルシアンブルー、コバルトブルー、アゾ系顔料、フタロシアニン系顔料、キナクリドン系顔

料、イソインドリノン系顔料、ジオキサジン系顔料、ス レン系顔料、ペリレン系顔料、ペリノン系顔料、チオイ ンジゴ系顔料、キノフタロン系顔料、金属錯体顔料、な どの従来公知の顔料を、一次粒子の大きさが10~10 Onmの範囲のものであれば、特に限定することなく用 いることができる。これらの顔料は、組み合わせて使用 することも可能である。染料は、従来から油性インク組 成物に用いられている染料のいずれでも使用可能である が、アゾ染料、ジスアゾ染料、金属錯塩染料、ナフトー ル染料、アントラキノン染料、インジゴ染料、カーボニ ウム染料、キノンイミン染料、シアニン染料、キノリン 染料、ニトロ染料、ニトロソ染料、ベンゾキノン染料、 ナフトキノン染料、キサンテン染料、フタロシアニン染 料、金属フタロシアニン染料、などの油溶性染料が好ま しい。これらの染料は、組み合わせて使用することも可 能である。本実施の形態では、色材として、染料及び顔 料がともに使用可能であるが、熱安定性、他ビヒクルと の溶解性に優れた溶解性染料を使用するのが望ましい。 これらの色材は、インクHIが十分な発色能力を有する ためには、インクHI中に0.1~10重量%含有する のが良く、プリンタにより印字する際の発色能力を考慮 すると0.5~8重量%含有するのが好ましく、更にプ リンタ動作時の熱変化でインクHIから染料が析出しな い、及び顔料が凝集しない保証として、1~5重量%含 有するのが一層好ましい。

【0047】上記した本実施の形態において用いるビヒ クル、またその他のビヒクルや添加剤などを用いる場合 には、それらはすべて常温において固体であるので、本 実施の形態のホットメルト型固体インクからなるホット メルトインクHIを調製するにあたり、それらをすべて 溶融温度よりも高い温度において溶融し、良く混合して 均一に分散させることが必要であり、かかる目的を達成 することができるならば、本実施の形態のホットメルト 型固体インクからなるホットメルトインクHIを調製す る手段は、何ら限定されず、任意の手段を用いてよい。 【0048】次に、本実施の形態のホットメルト型固体 インクからなるホットメルトインクHIを製造する手順 を説明する。本実施の形態において用いるビヒクルの各 々を上記の割合で、またその他のビヒクルや添加剤など を用いる場合には、それらを本実施の形態のホットメル ト型固体インクからなるホットメルトインクHIの性能 を損なわない範囲内の割合で容器中に入れ、ビヒクルを 用いる場合には添加剤などの溶融温度の内の最も高い溶 融温度よりも高い温度、通常70~250℃、好ましく は100~200℃程度の温度において加熱溶融し、次 いで色材を投入する。ビヒクルや添加剤などを用いる場 合には全組成が溶融されたら、プロペラなどの撹拌手段 を、均一な混合物を得るのに十分な回転速度及び時間、 通常200~10,000RPM、好ましくは500~ 5,000RPMで、通常数十分~数時間、好ましくは 1~2時間程回転させて混合物を十分に攪拌混合する。 攪拌混合は、混合物を1滴スライドグラス上に取り、光 学顕微鏡(200倍程度)にて凝集物がないことを確認 するまで行う。攪拌混合を終了した後に、得られた混合 物を溶融状態でろ過装置にかけてろ過を行い、不均一物 質をろ別し、フィルターを通過した物質を最終のホット メルト型固体インクとして得る。

【0049】熱溶融時のインク粘度は、インクジェットの吐出不良や目づまりを防ぐために、100~140℃において10~60mPa・sであるのが好ましく、10~40mPa・sであるのが一層好ましい。粘度がこの範囲よりも高過ぎる場合には、インクノズル内に圧力波などを発生させてもインクHIが流体としてではなく半固体として挙動するために、良好な量のインクHIが吐出されなかったり、全く吐出しなくなってしまう。また、粘度がこの範囲よりも低過ぎてもインクHIは良好に吐出されない。

【0050】次に、パージ動作について説明する。図6 は、パージ動作時におけるフロントエンドFE及びバッ クエンドBEの状態を示す模式図である。パージ動作 は、配線パターンの形成の前や、ノズル44が詰まるこ とによりインクHIの吐出に不良が生じた場合に、ノズ ル44からのインクHIの吐出を修復する動作である。 【0051】本実施の形態では、インクHIの廃棄量を 最小限にするために、パージ動作は、バックエンドBE のインクタンクをインクタンク主室71とインクタンク 副室72に分け、インクタンク主室71にピストンを備 えた加圧ポンプ79により加圧する。このとき、インク タンク主室71とインクタンク副室72は隔壁開閉弁7 5が閉じられるので、加圧ポンプ79の圧力はインクタ ンク副室72には加わらず、インクタンク主室71に加 圧された圧力は、インク供給パイプ76、導入路47a (図7参照)、インク還流パイプ77のインクHIを加 圧し、インクタンク副室72にインクHIが循環させら れる。そして、ポンピングチャンバーである加圧路47 b及び導出路47c (図7参照)のオリフィス面までの インクHIは循環されずに加圧によりノズル44から排 出される。このときにノズル44に詰まった粘度の高い インクHIなどが排出されインクHIの吐出が修復され る。

【0052】パージ動作によるノズル44から流出したインクHIがノズル44まわりに付着すると新たなインクHIの吐出を妨げ、また、装置の汚損のおそれがあるため、インクジェットへッド43(図1参照)のノズル44面のワイプ動作を行う。ワイプ動作は移動するインク吸収ロール85にインクジェットへッド43のノズル44面を押し当ててふき取る動作である。ここで、図4は、ワイプ動作を行うメンテナンス部7と、ヘッド部4の状態を示す模式図である。図4に示すように、インクジェットヘッド43のノズル44面は、メンテナンス部

7の開口部から露出したインク吸収ロール85に当接されるようにインクジェットへッド43がX軸駆動部2 (図1参照)によりX軸方向に移動され、第1支持部52aあるいは第2支持部52bにより垂直に変位される。ここで、インク吸収ロール85は、供給リール86aから繰り出され、送りローラ87a、87b、87c、87dにより搬送され、巻取リール86bにより搬送され、巻取リール86bにより搬送され、巻取リール86bによりがきき取られるノズル44面に対して相対的に移動し、前述のパージ動作によりノズル44から流出したり、通常のインクHIの吐出時に付着したノズル44面のインクHIを、常に清浄なインク吸収ロール85によりふき取る。このとき、インクHIが外気により固まらないように、メンテナンスヒータ88により加熱して、インクHIの流動性を維持する。

【0053】次に、検査エリア63に載置されたテストピースTPにテストパターンを形成し、これをヘッド部4に設けられたCCDカメラ42により着弾位置を認識する構成について図1を参照して説明する。

【0054】まず、ヘッド部4がX軸駆動部2により移動され、ステージ6上の検査エリア63がY軸駆動部3により移動されて、第1インクジェットヘッド43aあるいは第2インクジェットヘッド43bが、検査エリア63に載置されたテストピースTPに対向する所定位置にセットされる。テストピースTPは基本的に配線パターンを形成するプリント基板Pと同じ材料により形成される。このテストピースTPに対し、すべてのノズル44から、そのままの位置で、1ドット分のインクHIが吐出されることでテストパターンが形成される。もちろん、実際にテストピースTP上でX軸方向やY軸方向、あるいはこれらと所定の角度の斜線を形成するようなテストパターンを併せて形成するようにしてもよい。

【0055】次にヘッド部4及びステージ6を移動させて、認識手段を構成するCCDカメラ42の視野内テストパターンが入るようにする。CCDカメラ42は、カメラ本体に数倍のマクロレンズを付け、ハーフミラーによる同軸落写ユニットを用いて、テストパターンをファイバ照明により照明するように構成される。ここで得たCCDカメラ42による画像は、ケーブルCbを介してコンピュータPC、モニタMに転送される。

【0056】コンピュータPCは、図示しないCPU、RAM、ROM、ハードディスクドライブ、DVDドライブなどの記憶装置、外部とのデータの入出力が可能なI/Oポートを備え、出力装置であるディスプレーや入力装置であるキーボードなどを備えた周知の構成のコンピュータである。本実施の形態では、ハードディスク内に制御用のプログラムが格納されており、配線パターン形成装置1と一体に機能している。もちろん、このようなコンピュータPCを用いなくても、配線パターン形成装置1の本体10の制御盤11内のROMに格納されたような実施の形態でもよい。

【0057】コンピュータPCに転送された画像データは、X軸リニアエンコーダ24及びY軸リニアエンコーダ34から得たCCDカメラ42の位置情報から、インクHIの着弾地点である着弾ポイントを割り出す。この位置の割り出しは周知の画像認識の手法による。そして射出されたインクHIが着弾すべき画面上での位置である正規ポイントと比較する。画像データは、モニタMに映し出され、インクHIの着弾状況を観察することができる。この画面により、機械的な判断が困難な場合にマニュアルの補正を行うようにしてもよい。

【0058】図9は、CCDカメラ42の画面の一部を表した模式図である。図9において、ノズル44(K11)から射出されたインクHIが設計上着弾すべきポイントが正規ポイントRP(K11)であり、これに対して実際にノズル44(K11)から射出されたインクHIが着弾したポイントが着弾ポイントMP(k11)である。そしてこの対応する正規ポイントRP(K11)と着弾ポイントMP(k11)のずれを計測して、着弾位置を求める。同様に正規ポイントRP(K12)に対して、着弾ポイントMP(k12)、正規ポイントRP(K21)に対して、着弾ポイントMP(k21)、正規ポイントMP(k22)がそれぞれ対応するポイントになる。

【0059】ここで正規ポイントRP(K21)及び着 弾ポイントMP(k21)を例に説明すると、正規ポイ ントRP(K21)に対して、着弾ポイントMP(k2 1)は、反X方向に△Xずれており、Y方向に△Yずれ ていることがわかる。従って、正規ポイントRP(K2 1)に対応するノズル44は、本来の計算上の射出位置 よりX方向にΔXだけ、またY方向に-ΔYだけずれた 位置からインクHIを射出すれば、正規ポイントRP (K21)に正しく着弾するはずである。そのため、配 線パターンプリントの処理実行時にこのΔX及び-ΔY を補正値として、各ノズル44毎に、補正してインクH Iの吐出タイミングを変更させる。そのため、コンピュ ータPCのRAMに設けられた所定の記憶エリアにこの 位置データを着弾位置データとして記憶しておく。ま た、第1インクジェットヘッド43aと第2インクジェ ットヘッド43bについては、それぞれ別個に交換がで きるので、それぞれの着弾位置データを別の記憶エリア に記憶する。また、第1インクジェットヘッド43aと 第2インクジェットヘッド43bのいずれかを外した段 階で、補正値はクリアされる。即ち、一旦着脱をすると 補正値が変化し、誤ったデータで補正を行うと却ってず れが大きくなるからである。

【0060】なお、正規ポイントRPは、完全にX軸リニアエンコーダ24及びY軸リニアエンコーダ34から取得した位置情報で定めてもよいが、特定の点、例えば最も原点に近い点の着弾ポイントMPを正規ポイントRPとみなして、以後この点を基準に他の着弾ポイントM

Pのずれを計測してもよい。さらに、1列分の着弾ポイントMPを認識した後で、これらの平均的な中心を求めて、この直線を基準に正規ポイントを求めて、ずれを計測して補正値を求めるようにしてもよい。

【0061】正規ポイントRPから主走査方向(X軸方向)に±21μm、副走査方向(Y軸方向)に±14μmの範囲の正規エリアRAで着弾ポイントMPを探す。この範囲内に着弾がないと判断された場合には、インクHIの吐出不良と判断する。もちろんこの範囲は、ノズル44の射出精度や、ドット密度により適宜変更できるのはいうまでもない。

【0062】なお、着弾位置データは上記のような方法で記憶しておくが、他の要素の精度などのバランスから必要以上に細かいデータを取得する必要はなく、必要以上に細かいデータは記憶を保持する手段が必要になったり、処理の遅延などを招くため、これらのデータは、適度な精度で保持する。

【0063】ここで、図10は副走査方向の位置のずれ を補正する補正値の求め方を説明するための模式図であ る。前述のように、着弾ポイントMPは、正規ポイント RPに対して多様な方向にずれるが、これらはX方向と Y方向に分けて補正される。ここでは、副走査方向(Y 方向) の着弾のずれの補正値の求め方について詳説す る。図10に示すように、正規ポイントRPを中心とし て、正規ポイントRPのY方向のずれΔY(μm)が、  $-2\mu m < \Delta Y \le +2\mu m$ の場合は、ゾーン4とする。 以下、ここを中心に、 $4\mu$ m毎に区切って、 $-14\mu$ m  $<\Delta Y \le -10 \mu m$  of  $\hbar \xi y - \lambda 1$ ,  $-10 \mu m < \Delta$  $Y \le -6 \mu m$  of  $\hbar \epsilon Y - 2 = -6 \mu m < \Delta Y \le -2$  $\mu$ mのずれをゾーン3、 $+2\mu$ m $<\Delta$ Y $\leq$ + $6\mu$ mのず れをゾーン5、 $+6\mu$ m< $\Delta$ Y $\leq$ + $10\mu$ mのずれをゾ  $-\nu6$ 、 $+10\mu$ m $<\Delta$ Y $\leq$ + $14\mu$ m $\sigma$ f $\hbar$ f $\tau$ - $\nu$ 7とする。そして各ノズル44の着弾位置を、このゾー ンによりグループ分けを行う。例えば、正規ポイントR P(K11)に対して、着弾ポイントMP(k11) は、Y方向に-3μmずれているとすると、着弾ポイン トMPはゾーン3に属することになる。また、例えば、 正規ポイントRP(K12)に対して、着弾ポイントM P(k12)は、Y方向に+9μmずれているとする と、着弾ポイントMPはゾーン6に属することになる。 【0064】このように、着弾位置データに記憶された 副走査方向のずれ幅により、ゾーン1からゾーン7まで に分け、同じゾーンに属するノズル44の着弾のずれ は、同様の補正を行う。具体的には、ゾーン1は正規ポ イントRPから-14μm< $\Delta$ Y≤-10μmのずれを 持った着弾ポイントMPのグループである。そこで、こ のグループに属するノズル44はすべてずれの中心値で ある $-12\mu$ mのずれとみなして一律に $+12\mu$ mの補 正を行う。そうすれば、このグループでは、正規ポイン トRPからのずれが $-2\mu m < \Delta Y \le +2\mu m$ の間のず

れに補正される。同様に、ゾーン2では、正規ポイント RPから $-10\mu$ m $<\Delta Y \le -6\mu$ mのずれを持った着 弾ポイントMPのグループであるので、このグループに 関しては、ずれの中心値である $-8\mu$ mのずれとみなし て一律に $+8\mu$ mの補正を行う。そうすれば、このグループでも、正規ポイントRPからのずれが $-2\mu$ m $<\Delta Y \le +2\mu$ mの間のずれに補正される。同じようにゾーン1からゾーン7まで、各グループのずれの中心値で補正を行う。

【0065】以上副走査方向のずれについての補正値の 求め方について説明したが、主走査方向も、基本的に同 様で、正規ポイントRPに対する着弾ポイントMPのず れを、ずれの大きさでゾーンに分けて各ノズル44をグ ループ化する。そして各ゾーン毎に、ずれの中心値によ り補正値を求める。なお、主走査方向と副走査方向で は、必ずしも同じ精度ではないため、これらのゾーンの 区切りは異なるものとしてもよい。例えば、本実施の形 態では、 $\Delta X (\mu m)$ が $-21\mu m < \Delta X \leq -19\mu m$ の範囲をゾーン1、-19μm<ΔX≦-17μmの範 囲をゾーン2、以下 $2\mu$ m毎にゾーンをさだめ、 $-1\mu$ m<ΔX≦+1μmの範囲をゾーン11、+19μm<  $\Delta X \le +21 \mu m$ の範囲をゾーン21とする。なお、こ れらの範囲を超える場合は、インクHIの吐出不良とし て処理をする。そして、ゾーン1の補正値は+20 µ m、ゾーン2の補正値は $+18\mu m$ 、以下ゾーン11の 補正値は0μm、ゾーン21の補正値は-20μmとす る。

【0066】以上のようにゾーン毎に補正値を求める。 次に、プリント基板P上で配線パターンを形成するとき における具体的な補正の方法を説明する。ここでは先に 主走査方向の補正を説明する。図11は、主走査方向の 着弾位置の補正の方法を説明する図である。図11の上 段は、本来のファイアタイミングである正規タイミング RTを示す。1200dpi (dot per inc h)の画像密度では、各ドット間の距離はおよそ21 µ mになる。従って、例えばノズル44(K11)では、 連続してインクHIを吐出する場合でも、本来21μm 間隔で吐出する。本実施の形態では、キャリッジ41 が、X軸方向に2μm進む毎に、インクジェットヘッド 43のノズル44(K11)のピエゾ素子49にファイ ア電圧を印加可能なタイミングを10回与える。この1 0回のファイアタイミングを1セットとし、このうちの 1回のタイミングで1ドットを構成する。10回のファ イアタイミングのうち、いずれのタイミングでファイア するかは、ノズル44毎に設定可能とする。

【0067】例えば、あるノズル44の着弾ポイントM Pの主走査方向の誤差が $-10\mu$ mであるとすると、このノズル44はゾーン6にグループ分けされる。そうすると補正値は $+10\mu$ mになる。図12は、ファイア電圧の印加タイミングを示すタイムチャートである。従っ て、本来のファイアタイミングである正規タイミングR Tでピエゾ素子49にファイア電圧を印加すると、着弾 させたい点より10μm反X方向にずれてしまう。その ため、+10μm着弾位置をずらすためには、図12に 示すように正規タイミングRTより5ポイント遅いファ イアタイミングFTにすれば良い。そうすれば、本来の 着弾位置である正規ポイントRPにインクHIが着弾す る。このようにして、このノズルに関しては、常に正規 タイミングRTより5ポイント遅いファイアタイミング FTにすれば、必ず誤差が2μm以内の位置に着弾す る。

【0068】図13は、主走査方向の着弾位置の補正の方法を説明する図である。図13に示す場合は、着弾位置がゾーン18に入る場合で、補正値は-14μmである。従って、この場合はファイアタイミングFTを正規タイミングRTより7ポイント早くすることで、正規ポイントRPにインクHIを着弾させることができる。

【0069】次に、副走査方向の具体的な補正方法について説明する。 Y方向に副走査する場合は、主走査を1ライン行った後、1200dpiであれば、21 $\mu$ mY方向に移動して次の主走査を行うのが通常である。本実施の形態では、副走査は、本来の副走査に加え、正規位置よりY方向において、 $-12\mu$ m、 $-8\mu$ m、 $-4\mu$ m、 $+4\mu$ m、 $+8\mu$ m、 $+12\mu$ mずれた位置を含め合計7ラインで主走査できるように副走査を行う。そして、 $-12\mu$ mずれた位置では、ゾーン1にグループ分けされたノズル44のピエゾ素子49にファイア電圧を印加される。また、 $-8\mu$ mずれた位置では、ゾーン2にグループ分けされたノズル44のピエゾ素子49にファイア電圧を印加される。同様に $+12\mu$ mずれた位置では、ゾーン7にグループ分けされたノズル44のピエゾ素子49にファイア電圧を印加される。

【0070】つまり、正規位置よりY方向に-12µm ずれた位置で、副走査を行えば、正規位置において着弾 した位置より、Y方向に-12μmずれた位置に着弾す ることになる。図10において、着弾ポイントMP(k 11)は、正規ポイントRP(K11)よりY方向に-3μmずれているためゾーン3にグループ分けされ、+  $4\mu$ mずれた位置で副走査される。その結果 $+1\mu$ mず れた位置h11に着弾する。また、着弾ポイントMP (k12)は、正規ポイントRP(K12)よりY方向 に+9µmずれているためゾーン6にグループ分けさ れ、 $-8\mu$ mずれた位置で副走査される。その結果+1μmずれた位置h 12に着弾する。このように副走査距 離を細かく変化させ、各ゾーンにグループ分けされたノ ズル44がそれぞれインクHIを吐出するように制御さ れるため、すべてのノズル44の副走査方向の着弾位置 の誤差は $-2\mu m$ から $+2\mu m$ の間になる。

【0071】本実施の形態の配線パターン形成装置1 は、以上のように構成されるため、以下のような動作を 行う。図14は、配線パターン形成装置1の動作を示す フローチャートである。このフローチャートに沿って配 線パターン形成装置1の動作を説明する。まず、配線パ ターン形成装置1を起動させると、第1インクジェット ヘッド43a(以下第1ヘッドと略記する。)が駆動さ れるかどうか判断される(ステップ1。以下ステップを Sと略記する。)。ここで第1ヘッドが装着され駆動の 準備ができているような場合(S1:YES)は、第1 ヘッドの吐出の良否が判断される(S3)。吐出の良否 は、上述のように検査エリア63において、テストピー スTP上に形成されたテストパターンをCCDカメラ4 2により画像認識し、正規エリアRAで着弾ポイントM Pを探す。この範囲内に着弾がないと判断された場合に は、インクHIの吐出不良と判断する。第1ヘッドのイ ンクHIが吐出不良と判断された場合(S3:NO)、 修復動作が2回目以上でなければ(S5:NO)、つま り初めての修復動作に当たるときは、上述のパージ動作 及びワイプ動作による第1ヘッド修復動作が実行される (S7)。第1ヘッド修復動作が終了したら、再び第1 ヘッドの吐出の良否が再び判断される(S3)。

【0072】もし、ここで第1ヘッドのインクHIが吐 出不良と判断された場合(S3:NO)、次の修復動作 は2回目以上になるので(S5: YES)、第1ヘッド の修復動作(S7)は行わず、第2インクジェットヘッ ド43b(以下第2ヘッドという。)が駆動されるかど うか判断される(S9)。ここで第2ヘッドが装着され てなかったり駆動の準備ができてないような場合には (S9:NO)、使用できるインクジェットヘッド43 がないため、処理を終了する(エンド)。また、第2へ `ッドが装着され駆動の準備ができているような場合(S 9:YES)は、第2ヘッドの吐出の良否が判断される (S11)。第2ヘッドのインクHIが吐出不良と判断 された場合(S11:NO)、修復動作が2回目以上で なければ(S13:NO)、第2ヘッド修復動作が実行 される(S15)。第2ヘッド修復動作が終了したら、 再び第2ヘッドの吐出の良否が判断される(S11)。 もし、このとき第2ヘッドのインクHIが吐出不良と判 断された場合(S11:NO)、修復動作が2回目以上 になるので(S13:YES)、第1ヘッドも第2ヘッ ドも使用不能として処理を終了する(エンド)。

【0073】S3において第1ヘッドがインクHIの吐出が良好と判断された場合(S3:YES)、あるいはS11において第2ヘッドがインクHIの吐出が良好と判断された場合(S11:YES)、着弾位置の補正データの有無が判断される(S17)。着弾位置の補正データとは、前述のようにCCDカメラ42による画像を認識した結果、各ノズル44毎の正規ポイントRPと着弾ポイントMPとの主走査方向および副走査方向のずれの大きさをコンピュータPCのRAM内の所定の記憶エリア(不図示)に記憶したもので、この記憶エリアの内

容を検索し、その結果着弾位置の補正データがないとされた場合は(S17:NO)、補正ができないので、現状のまま補正しないで配線パターンのプリントを行う(S23)。

【0074】一方、着弾位置の補正データの有無が判断され(S17)、所定の記録エリアに着弾位置の補正データがある場合は(S17:YES)、この記憶エリアから着弾位置の補正データを、コンピュータPCのRAMに設けられた補正処理用の記憶エリアに読み込み(S19)、着弾位置の補正を行う。なお、着弾位置の補正データは、第1インクジェットへッド43aと第2インクジェットへッド43bに分けて記憶されているので、S3で第1へッドの吐出が良好とされた場合は、第1へッドの着弾位置の補正データが、S11で第2へッドの吐出が良好とされた場合は、第2へッドの着弾位置の補正データが補正処理用の記憶エリアにそれぞれ読み込まれることになる。

【0075】このように補正処理用の記憶エリアに読み込まれたデータに基づいて、着弾位置補正処理が行われる(S21)。ここで図15は、図14のS21の着弾位置補正処理の手順を示すフローチャートである。着弾位置補正は、副走査方向着弾位置補正処理(S211)と、主走査方向着弾位置補正処理(S213)とに分けて処理される。

【0076】図16は、図15のS211の副走査方向着弾位置補正処理の手順を示すフローチャートである。所定の順序に従って次に補正すべきノズル44の副走査方向の $\Delta$ Yの数値を補正処理用の記憶エリアから処理用のワークエリアに読み込み(S2111)、 $\Delta$ Yが-14< $\Delta$ Y $\leq$ -10の範囲であるかどうかが判断され(S2112)、 $\Delta$ Yが-14< $\Delta$ Y $\leq$ -10の範囲である場合には(S2112:YES)、このノズル44はゾーン1のグループに分類され、補正値が+12に決定される(S2113)。即ち、後述する配線パターンプリント(S23)の処理において、本来の副走査よりも+12 $\mu$ m副走査方向(Y方向)に進めた位置で主走査が行われ、その結果、これらの着弾位置のずれが補正される。

【0077】ここで、配線パターンプリント(S23)の処理について、先に説明をする。コンピュータPCに入力された配線パターンのデータは、1200dpiの間隔でプリントすべきマトリクス状に配列されたドットがデータ圧縮されて記憶されたビットマップデータであるが、ここでは、そのデータをフローチャート外の処理においてプリント用のデータに変換され、RAMの中のプリント用の所定の出力用のバッファに記憶されている。データの変換は、圧縮されたデータを展開するだけでなく、本来のノズル44がプリントするドットの位置に対して、X方向及び反X方向に2μmずつずれた20カ所の補正用のプリント位置(図11参照)が、Y方向

及び反Y方向に4μmずつずれた位置に6ライン設けられている。従って、1のノズル44がインクHIを吐出する位置は、X軸方向に21カ所、それがY軸方向に7列の計147カ所の位置が準備される。そして、配線パターンプリント(S23)の処理においては、S21により補正された147カ所のうちのいずれかの位置でインクHIが吐出されるように制御され、所望の着弾位置にインクHIを着弾させる。

【0078】S2113において、そのノズル44の補正値が+12とされると、バッファ中で展開されたそのノズル44のデータが補正された位置に書き換えられる(S2126)。同様に、所定の順序に従って処理すべき次のノズル44についてのデータがあれば(S2127:YES)、このデータも、ノズル44の副走査方向の $\Delta$ Yの数値をワークエリアから処理用のワークエリアに読み込まれ(S2111)、 $\Delta$ Yが-14< $\Delta$ Y $\leq$ -10の範囲であるかどうかが判断され(S2112)、 $\Delta$ Yが-14< $\Delta$ Y $\leq$ -10の範囲であるかどうかが判断され(S2112)、 $\Delta$ Yが-14< $\Delta$ Y $\leq$ -10の範囲である場合には(S2112:YES)、このノズル44はゾーン1のグループに分類され、補正値が+12に決定される(S2113)。

【0079】また、ΔYが-14<ΔY≦-10の範囲 ではない場合には(S2112:NO)、 $\Delta Yが-10$ <△Y≦-6の範囲であるかどうかが判断され(S21 14)、ΔYが-10<ΔY≦-6の範囲である場合に は(S2114:YES)、このノズル44はゾーン2 のグループに分類され、補正値が+8に決定される(S 2115)。以下、ΔYが-10<ΔY≦-6の範囲で はない場合には(S2114:NO)、 $\Delta Yが-6<\Delta$ Y≦-2の範囲であるかどうかが判断され(S211 6)、 $\Delta Y$ が $-6 < \Delta Y \le -2$ の範囲である場合には (S2116:YES)、このノズル44はゾーン3の グループに分類され、補正値が+4に決定される(S2 117)。また、 $\Delta Y$ が-6< $\Delta Y$   $\leq -2$ の範囲ではな い場合には(S2116:NO)、 $\Delta Y$ が $-2 < \Delta Y \le$ +2の範囲であるかどうかが判断され(S2118)、  $\Delta Y$ が-2< $\Delta Y$   $\leq$  +2の範囲である場合には(S21) 18:YES)、このノズル44はゾーン4のグループ に分類され、補正はされない(S2119)。また、△ Yが-2<ΔY≦+2の範囲ではない場合には(S21 18:NO)、 $\Delta Y + 2 < \Delta Y \le +6$ の範囲であるか どうかが判断され(S2120)、 ΔYが+2<ΔY≦ +6の範囲である場合には(S2120:YES)、こ のノズル44はゾーン5のグループに分類され、補正値 が-4に決定される(S2121)。また、ΔYが+2 <a>ΔY≦+6の範囲ではない場合には(S2120:N</a> O)、 ΔYが+6 < ΔY≤+10の範囲であるかどうか</p> が判断され(S2122)、 $\Delta Y$ が+6< $\Delta Y$ ≤+10の範囲である場合には(S2122:YES)、このノ ズル44はゾーン6のグループに分類され、補正値が一

8に決定される(S2123)。

【0080】なお、 $\Delta Y$ が+6< $\Delta Y$ ≦+10の範囲ではない場合には(S2122:NO)、 $\Delta Y$ が+10<  $\Delta Y$ ≦+14であるので(S2124)、このノズル44はゾーン7のグループに分類され、補正値が-12に決定される(S2125)。なぜなら、これ以外の範囲、 $\Delta Y$ ≦-14と $\Delta Y$ >14の範囲では、S3あるいはS11においてヘッドの吐出不良と判断されているからである。

【0081】以上S2113、S2115、S2117、S2119、S2121、S2123、S2125の処理において補正値が決められたノズル44の吐出位置のデータは、上述のようにこの補正値に従って出力用のバッファに記憶されたビットマップデータが書き換えられる(S2126)。

【0082】以上の手順を繰り返し、次に補正すべきノズル44のデータがなくなれば(S2127:NO)、図15のS211における副走査方向着弾位置補正処理の手順が終了される(リターン)。

【0083】次に、図15の主走査方向着弾位置補正処理(S213)が行われる。ここでの処理も、副走査方向着弾位置補正処理(S211)の手順と同様の処理が行われるので、詳細は省略する。

【0084】図14の着弾位置補正(S21)が終了すると、配線パターンプリント(S23)の処理が行われる。配線パターンプリント(S23)の処理では、上述のように補正されたビットマップデータに従って、プリント基板P上の所定の位置にインクHIが吐出され、インクHIによりレジストパターンが形成される。主走査方向の位置は、X軸駆動部2により一定の速度で移動するインクジェットへッド43の各ノズル44の吐出タイミングを変更することでその位置を補正し、副走査方向は、副走査の距離を変更し、副走査方向のずれの分に相当する位置で、同様のずれ傾向を持ったグループにグループ化されたノズル44からインクHIを吐出することでその吐出位置を補正する。

【0085】ここで、次にプリント基板Pを交換して配線パターンプリントを続行する場合、あるいはプリント基板Pを反転してプリント基板P裏面にプリントを続行する場合(S25:YES)、プリント基板Pの交換あるいは反転をした後(S27)、プリントの経過時間などにより吐出の再検査を行うかどうかを判断し(S29)、吐出の再検査を行わない場合は(S29:NO)再び配線パターンプリント(S23)の処理を行う。また、所定時間が経過するなどして、吐出の再検査を行うと判断された場合は(S29:YES)、再びS1からの処理を繰り返す。プリントを続行しない場合(S25:NO)には、処理を終了する(エンド)。

【0086】本発明に係る実施の形態のプリント基板Pの配線パターン形成装置1は、上記の様な構成を有し、

上記の様な動作をするので以下のような効果がある。描画エリア62で配線パターンが形成されたプリント基板 Pとは別に、検査エリア63でテストパターンが形成されたテストピースTPを認識し判断することができるという効果がある。そのため、インクジェットへッド43のインクHIの吐出の着弾位置のずれや、吐出不良などがわかり、描画エリア62でプリント基板Pに配線パターンを形成する前にインクHIの吐出不良による配線パターンの形成の不良を簡単に回避でき、且つ検査員による描画後の検査が省略でき、不良品を出さないで、プリント基板Pに配線パターンのレジストパターンを高い生産効率で高精度に形成することができるという効果を奏する。

【0087】判断手段であるコンピュータPCによりイ ンクジェットヘッド43から吐出されたインクHIの着 弾位置が所定位置からずれていると判断された場合に は、補正手段であるコンピュータPCによりインクHI の吐出位置を補正することができるという効果がある。 従って、配線パターンをプリント基板P上により高精度 で形成できるという効果を奏する。特に、本実施の形態 では、複数のノズル44が略直線状のアレイ状に配置さ れたインクジェットヘッド43により、1回の主走査で 複数のラインを形成できるばかりでなく、判断手段であ るコンピュータPCにより求められた各ノズル44の副 走査方向のずれの大きさAYに基づいて複数のグループ であるゾーン1からゾーン7に分け、このグループ毎に 異なる距離の副走査を行って主走査を行うことにより、 主走査位置を変更する複数のノズル44から射出される 各ノズル44固有の着弾位置のずれを修正し、インクジ ェットヘッド43全体の位置のずれを簡単な制御で極め て小さいものとすることができるという効果がある。従 って、ノズル44毎の副走査方向の着弾位置のずれの大 きさΔYにかかわらず、プリント基板Pの配線パターン を極めて高い精度で形成することができるという効果を 奏する。

【0088】また、判断手段であるコンピュータPCにより判断された各ノズル44の主走査方向のずれの大きさムXに基づいて、ノズル44単位で所定のインクHIの吐出の正規タイミングRTに対してファイアタイミングFTをずらしてインクHIを吐出することにより、複数のノズル44から射出される各ノズル44固有の着弾位置のずれムXを修正し、インクジェットへッド43全体の主走査方向の位置のずれムXを簡単な制御で極めて小さいものとすることができるという効果がある。従って、ノズル44毎の主走査方向の着弾位置のずれムXの大きさにかかわらず、プリント基板Pの配線パターンを極めて高い精度で形成することができるという効果を奏する。

【0089】また、描画エリア62でプリント基板Pに 配線パターンを形成する前に判断手段であるコンピュー タPCによりインクジェットヘッド43のインクHIの 吐出不良と判断された場合に、修復手段であるパージ機 構及びワイプ機構によりインクジェットヘッド43のインクHIの吐出を修復させることができるという効果が ある。従って、判断手段によりインクHIの吐出が不良 と判断されても、インクHIの吐出不良がない状態に修 復可能で、生産ラインの作業を中断することなく、描画 エリア62でプリント基板Pに配線パターンを形成する ことができるという効果を奏する。

【0090】さらに修復手段であるパージ機構及びワイプ機構によっては第1インクジェットへッド43aのインクHIの吐出を修復できなかったと判断された場合でも、第2インクジェットへッド43bを備えているため、配線パターン形成装置1の稼働を中断することなく、第2インクジェットへッド43bによりプリント基板P上に配線パターンを形成することができるという効果がある。従って、生産ラインの作業を中断することなく、高い生産効率でプリント基板Pの生産をすることができるという効果を奏する。

【0091】以上、1の実施の形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施の形態に何ら限定されるものではない。

【0092】例えば、インクジェットヘッド43は、描画エリア62、検査エリア63及びメンテナンス部7に対して相対的にX軸方向及びY軸方向に変位可能であればよく、インクジェットヘッド43自体がX軸方向及びY軸方向のいずれの方向にも移動可能であるように構成してもよく、あるいは逆に、インクジェットヘッド43を固定し、ステージ6自体がX軸方向及びY軸方向のいずれの方向にも移動可能になるように構成してもよい。【0093】また、インクジェットヘッド43に使用するインクは、熱溶融性を有するホットメルトインクHIに限られず、UVにより硬化する光硬化性のインクなど、パターン形成後に収縮しないものを好適に用いることもできる。なお、有機溶剤などを蒸発させて硬化させるタイプはレジスト層が薄くなったり乾燥後の寸法の誤差が生じるため、使用はできるが望ましくはない。

【0094】また、インクジェットヘッド43の数は2つに限定されず1あるいは、3以上のヘッド構成としても良い。さらに、本実施の形態ではインクジェットヘッドユニット45を4つ備えたものを例示したが、1、2、3あるいは5以上のものであってもよい。そして、本実施の形態のようにオフセットして配置するほか、主走査方向に並べて配置してもよい。さらにノズル配列もY軸方向に2列に配列されたもの以外でも、1列のものや、千鳥状に配列されたものや種々の構成が考えられる。

【0095】また、パージ動作は、ノズル44の外側からインクHIを吸引するようなものでも良い。ワイプ動作は、ゴム製や、スポンジなどの多孔質のワイパーで掻

き取るようにワイピングするようなものや、あるいは静 止している吸収体に当接させるようなものでもよい。

【0096】さらに、当業者が、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の改良をし変更することが可能であることは容易に推察できるものである。

### [0097]

【発明の効果】上記説明から明らかなように本発明は以下のような効果がある。即ち、請求項1に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、描画エリアで配線パターンが形成されたプリント基板とは別に、検査エリアでテストパターンが形成されたテストピースを認識し判断することができるという効果がある。そのため、インクジェットへッドのインクの吐出の着弾位置のずれや、吐出不良などがわかり、描画エリアでプリント基板に配線パターンを形成する前にインクの吐出不良による配線パターンを形成の不良を簡単に回避でき、且つ検査員による描画後の検査が省略でき、不良品を出さないでプリント基板に配線パターンのレジストパターンを高い生産効率で高精度に形成することができるという効果を奏する。

【0098】請求項2に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、請求項1に記載のプリント基板の配線パターン形成装置の効果に加え、判断手段によりインクジェットヘッドから吐出されたインクの着弾位置が所定位置からずれていると判断された場合には、補正手段によりインクの吐出位置を補正することができるという効果がある。従って、より高精度に配線パターンをプリント基板上に形成できるという効果を奏する。

【0099】請求項3に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、請求項2に記載のプリント基板の配線パターン形成装置の効果に加え、複数のノズルが略直線状のアレイ状に配置されたインクジェットへッドにより、1回の主走査で複数のラインを形成できるばかりでなく、判断手段により求められた各ノズルの副走査方向のずれの大きさに基づいて複数のグループに分け、該グループ毎に異なる距離の副走査を行って主走査を行うことにより、複数のノズルから射出される各ノズル固有の着弾位置のずれを修正し、インクジェットへッド全体の位置のずれを簡単な制御で極めて小さいものとすることができるという効果がある。従って、ノズル毎の副走査方向の着弾位置のずれの大きさにかかわらず、極めて高い精度でプリント基板の配線パターンを形成することができるという効果を奏する。

【0100】請求項4に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、請求項2又は請求項3に記載のプリント基板の配線パターン形成装置の効果に加え、判断手段により判断された各ノズルの主走査方向のずれの大きさに基づいて、ノズル単位で所定のインクの吐出タイミングに対してタイミングをずらしてインクを吐出することにより、複数のノズルから射出される各ノズル固

有の着弾位置のずれを修正し、インクジェットヘッド全体の位置のずれを簡単な制御で極めて小さいものとすることができるという効果がある。従って、ノズル毎の主走査方向の着弾位置のずれの大きさにかかわらず、極めて高い精度でプリント基板の配線パターンを形成することができるという効果を奏する。

【0101】請求項5に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、請求項1乃至請求項4のいずれかに記載のプリント基板の配線パターン形成装置の効果に加え、描画エリアでプリント基板に配線パターンを形成する前に判断手段によりインクジェットへッドのインクの吐出不良と判断された場合に、修復手段によりインクジェットへッドのインクの吐出を修復させることができるという効果がある。従って、判断手段によりインクの吐出が不良と判断されても、インクの吐出不良がない状態に修復可能で生産ラインの作業を中断することなく描画エリアでプリント基板に配線パターンを形成することができるという効果を奏する。

【0102】請求項6に係る発明のプリント基板の配線パターン形成装置では、請求項5に記載のプリント基板の配線パターン形成装置の効果に加え、パージ機構あるいはワイプ機構又はその双方によりインクジェットヘッドのインクの吐出を確実に修復することができるという効果がある。

【0103】請求項7に係る発明のプリント基板のパターン形成装置では、請求項1乃至請求項6のいずれかに記載のプリント基板のパターン形成装置の効果に加え、修復手段によっては1のインクジェットへッドのインクの吐出を修復できなかったと判断された場合でも、複数のインクジェットへッドを備えているため、プリント基板の配線パターン形成装置の稼働を中断することなく、1のインクジェットへッドと異なる他のインクジェットへッドによりプリント基板上に配線パターンを形成することができるという効果がある。従って、生産ラインの作業を中断することなく、高い生産効率でプリント基板の生産をすることができるという効果を奏する。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】配線パターン形成装置1の概略を示す図である。

【図2】ヘッド部4の機能の概略を示すブロック図であ

【図3】図7におけるA-A部分におけるインクジェットヘッドユニット45の模式断面図である。

【図4】ワイプ動作を行うメンテナンス部7と、ヘッド 部4の状態を示す模式図である。

【図5】フロントエンドFE及びバックエンドBEの構造を示す模式図である。

【図6】パージ動作時におけるフロントエンドFE及び バックエンドBEの状態を示す模式図である。

【図7】インクジェットヘッドユニット45の一部を拡

大して見た底面図である。

【図8】第1インクジェットヘッド43aをノズル44 面から見た模式図である。

【図9】CCDカメラ42の画面の一部を表した模式図である。

【図10】副走査方向の位置のずれを補正する補正値の 求め方を説明するための模式図である。

【図11】主走査方向の着弾位置の補正の方法を説明する図である。

【図12】ファイア電圧の印加タイミングを示すタイム チャートである。

【図13】主走査方向の着弾位置の補正の方法を説明する図である。

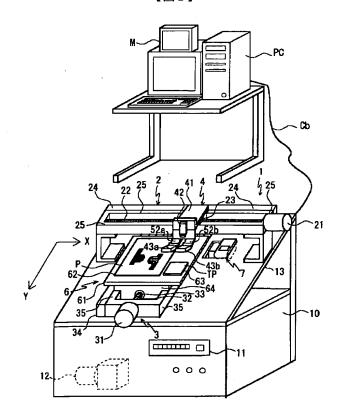
【図14】配線パターン形成装置1の動作を示すフローチャートである。

【図15】図14のS21の着弾位置補正処理の手順を示すフローチャートである。

【図16】図15のS211の副走査方向着弾位置補正 処理の手順を示すフローチャートである。

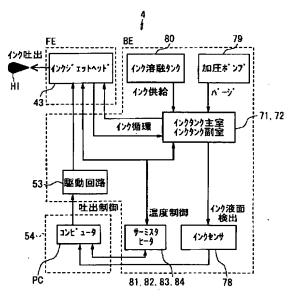
# 【符号の説明】

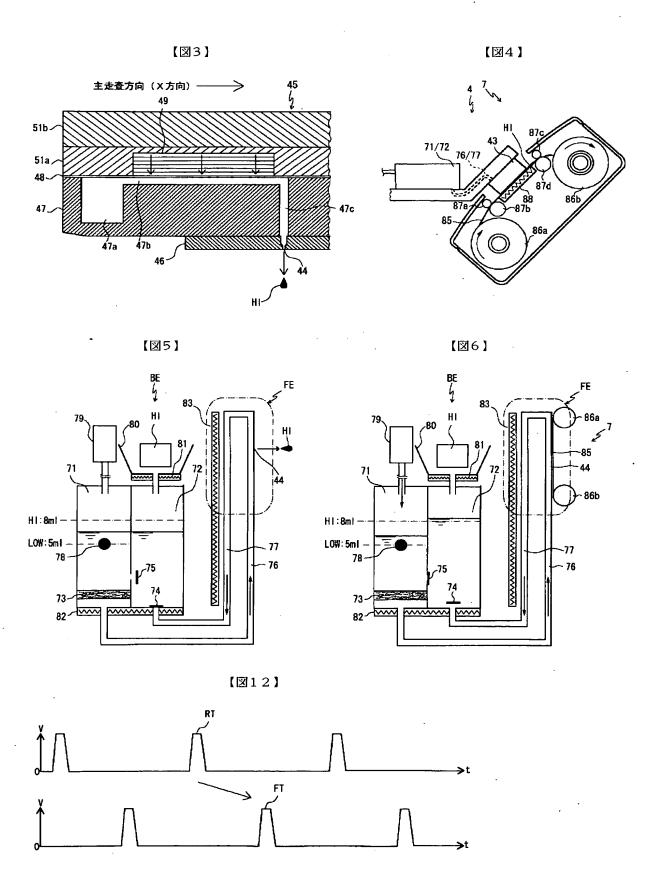
# 【図1】

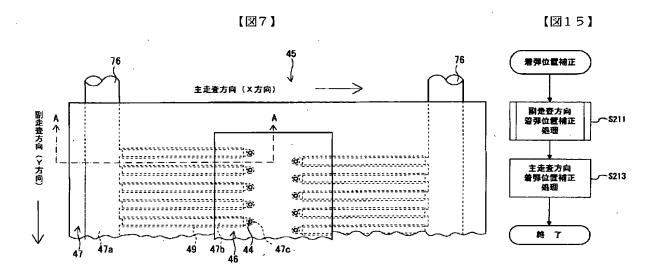


- 1 プリント基板の配線パターン形成装置(配線パターン形成装置)
- 2 X軸駆動部
- 3 Y軸駆動部
- 4 ヘッド部
- 6 ステージ
- 7 メンテナンス部
- 10 本体
- 41 キャリッジ
- 42 CCDカメラ
- 43 インクジェットヘッド
- 43a 第1インクジェットヘッド
- 43b 第2インクジェットヘッド
- 44 ノズル
- 62 描画エリア
- 63 検査エリア
- CP コンピュータ
- HI ホットメルトインク (インク)
- P プリント基板
- TP テストピース

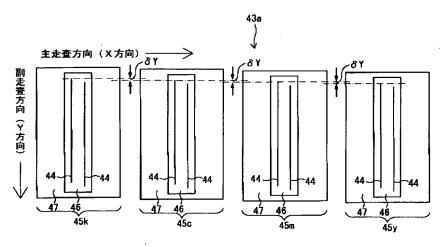
#### 【図2】



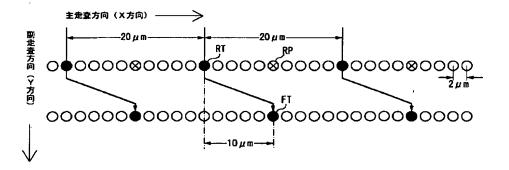




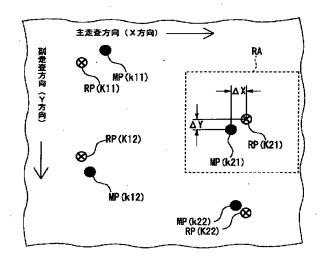




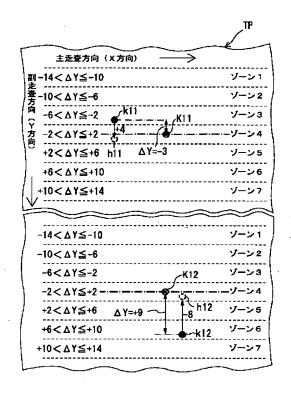
【図11】



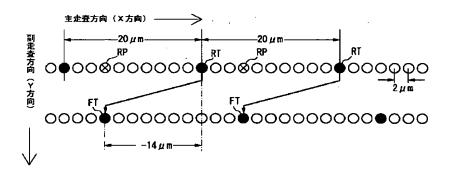
【図9】



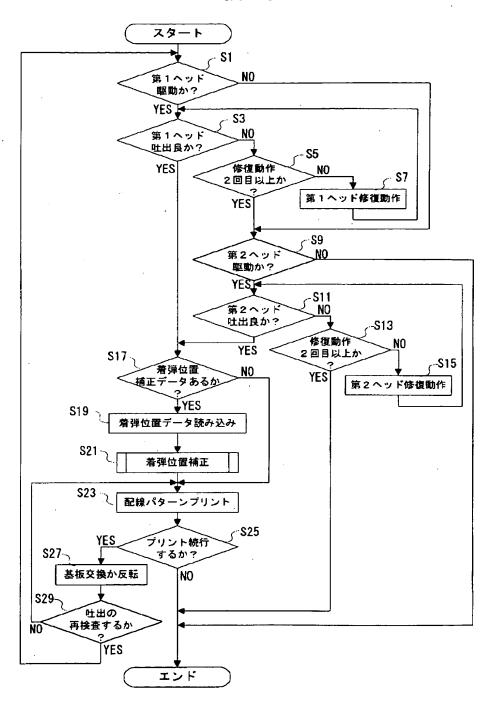
【図10】



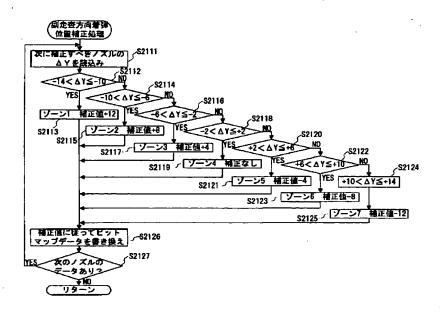
【図13】



【図14】



# 【図16】



【手続補正書】

【提出日】平成11年8月3日(1999.8.3)

【補正方法】変更

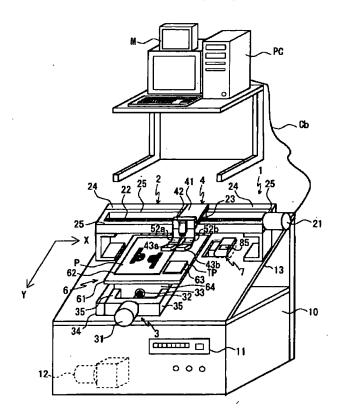
【手続補正1】

【補正内容】

【補正対象書類名】図面

【図1】

【補正対象項目名】図1



フロントページの続き

Fターム(参考) 2C056 EB27 EB36 EB40 EC08 EC37 FA15 FB05 4F041 AA02 AB01 5E339 CD01 CE13 CE20 EE03 EE10